

interOpto2020 出展案内

インターリークは、光の構成要素からシステムまでを網羅し、研究用途から産業応用に至るまでの光デバイス・レーザ関連製品が一堂に会する光の技術総合展です。

最新光技術の応用先は精密機器や半導体、通信、計測からバイオテクノロジーに至るまで多岐に渡っており、その中でも特に注目度の高いアプリケーションに特化した専門展示会として、LED応用の最先端技術・製品をテーマにしたLEDの設計製造展「LED JAPAN」、撮影・撮像、画像処理、画像センシング、ディスプレイ・投影に関する技術と製品をテーマにした最先端のイメージング技術が集結する展示会である「Imaging Japan」と共に、次世代アプリケーション・デバイスを目指した光学技術+製品開発のパートナリングイベント『All about Photonics』として最新情報を発信し、新たなビジネスマッチングを実現します。

今回より、開催場所を東京ビッグサイトに、開催時期を1月下旬に変更するとともに、新たにナノテクノロジーの国際総合展示会である「nano tech」と同時開催とすることにより、光技術とMEMS、ナノテクノロジーを網羅する総合技術展示会として開催いたします。

会期： 2020年1月29日（水）～31日（金） 10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト 西2ホール

入場料： 3,000円（税込） ※事前登録者及び招待状持参者は無料

同時開催： 「MEMSセンシング&ネットワークシステム展 2020」

「nano tech 2020」ほか10展示会

出展対象分野

レーザ／光源	半導体、ファイバ、YAG、超短パルス等の各種レーザ発振器、可視光LED、UV-LED、テラヘルツ～中・近赤外～紫外域各種光源、受発光素子 等
オプティクス関連部品	レンズ／フィルタ、ミラー／プリズム、ガラス、光学薄膜、光スキャナ 等
測定装置/光分析機器	光測定器、光応用計測器、分光／分析装置、分光光度計、近赤外分光計、OCT装置、光センシング機器、光伝送装置 等
レーザ加工システム	レーザ加工装置(微細・切断・穴あけ)、マーリング装置、医療用レーザ装置、3Dプリンタ、ガルバノスキャナ、試作・受託加工 等
情報通信	可視光通信、次世代通信(5G)、光通信デバイス、光ファイバ・コネクタ 等

出展受付期間

出典申込締切：2019年9月30日（月）

※但し、締切日前でも規定の小間数になり次第受付終了とさせて頂きますので、お早めにお申込みください。

申込方法につきましては下記ホームページを参照下さい。

<http://www.optojapan.jp/interopto/>